

独立行政法人產業技術総合研究所



## 1. 高速(<1µs)過渡応答測定

## ■ 過渡応答測定装置



・スイッチング回路とシャントレギュレータにより
ステップ電圧を供給

・モジュールが発生する高速電流波形を測定

🔲 容量性リアクタンスCの計算

Step1: 観測した電流波形より電荷Qを計算 Step2: Qをステップ電圧Vsで微分→容量Cを算出

$$C(V_S) = \frac{dQ(V_S)}{dV_S}$$

🔲 PVモジュール (薄膜、結晶Si、高効率Si)

	PVの種類		セルサイズ /直列数	測定条件	
No.				Irradiance (kW/m <sup>2</sup> )	V <sub>OC</sub> (V) / I <sub>SC</sub> (A)
#1	薄膜	a-Si/µ-Si	8.6 x 890 mm	0.79	58.4
		Tandem	50直列		0.63
#2		CIGS	5.4 x 1200 mm	0.82	48.9
			110 直列		1.66
#3	結晶 Si	Single	12.8 cm 🗆	0.85	10.6
		crystal	18直列		4.3
#4		Poly	15.5 cm 🗆	0.85	9.23
		crystalline	18直列		6.5
#5	高効率 Si	HIT	12.4 cm 🗆	0.88	16.1
			24 直列		4.9
#6		Backside	12.4 cm 🗆	0.83	9.9
		contact	16 直列		4.3



PVモジュール写真

・1クラスタで測定 (#3~#6) ・バイパスダイ オードは取り外す



## 1. 高速(<1µs)過渡応答測定



独立行政法人產業技術総合研究所







過渡現象の再現に成功

\*1) Y. Hishikawa, Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference (WCPEC), pp.1279-1282 より引用

0.12

9.4

32

Backside

contact

9.9

Si

#6

独立行政法人產業技術総合研究所

1.1